



Patent tymczasowy dodatkowy
do patentu nr _____

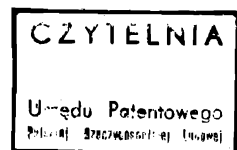
Int. Cl.³ B21D 37/08

Zgłoszono: 11.05.79 (P. 215507)

Pierwszeństwo _____

Zgłoszenie ogłoszono: 21.04.80

Opis patentowy opublikowano: 15.12.1983



Twórcy wynalazku: Andrzej Reputakowski, Stanisław Waszuk, Tadeusz Bednarski

Uprawniony z patentu tymczasowego: Zakłady Lamp Oscyloskopowych L-12,
Piaseczno (Polska)

**Sposób i urządzenie
do kształtowania jednoczęściowej miseczki wyprowadzenia anody
zwłaszcza lampy kineskopowej**

Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do kształtowania jednoczęściowej miseczki wyprowadzenia anody zwłaszcza lampy kineskopowej.

Znany sposób kształtowania miseczki wyprowadzenia anody polegał na wytłoczeniu na prasie mimośrodowej miseczki stożkowo-cylindrycznej oraz oddzielnym wytłoczeniu pierścienia, a następnie zaciśnięciu pierścienia również na prasie mimośrodowej. Kształtowanie górnego fragmentu wyprowadzenia anody realizowane metodami obciskania powoduje zmniejszenie wymiarów poprzecznych. Dzięki zaciśniętemu pierścieniowi w gotowym detalu uzyskuje się pomniejszenie otworu do wymaganej średnicy.

Sposób kształtowania miseczki wyprowadzenia anody z oddzielnym wytłoczeniem pierścienia a następnie jego zaciskaniem wymaga wielu pracochłonnych operacji technologicznych, takich jak tłoczenie pierścienia, mycie i zaciskanie oraz tłoczenie i bębnowanie miseczki.

Sposób według wynalazku polega na obciskaniu górnej ścianki cylindrycznej stożkowej miseczki wyjściowej znajdującej się w matrycy. Obciskanie realizowane jest naciskiem pionowym kolejnych stempli o różnym kącie pochylenia powierzchni kształtującej. Detal w kolejnych fazach obciskania znajduje się w jednej i tej samej matrycy. W procesie kształtowania stosowane są dociskacze dna miseczki osadzone sprężystość wewnątrz stempli obciskających. Urządzenie według wynalazku posiada zespół stempli z możliwością regulacji położenia pionowego bez konieczności zdejmowania przyrządu z prasy oraz zespół matryc z wciskanymi tulejami pozwalającymi na usuwanie gotowych detali.

Przedmiot wynalazku przedstawiony jest w przykładzie wykonania na rysunku, który przedstawia schematycznie urządzenie do obciskania miseczki wyprowadzenia anody.

Jak uwidoczniło na rysunku obciskanie realizowane jest naciskiem pionowym prasy w przyrządzie o dwóch słupach 1. Przyrząd składa się z podstawy 2, płyty głowicowej 3, czopa 4, płyty stemplowej 5, zespołu stempli 6 z dociskaczami 7, tulei 8 wewnątrz których znajdują się osadzone na tarczy podajnika rewolwerowego 9 matryce 10. W płycie stemplowej 5 znajdują się zderzaki 11 służące do wciskania tulei 8. Do podstawy przykręcona jest rynna 12 odprowadzająca gotowe

detale oraz rozdzielacz powietrza 13. Miseczki wyjściowe umieszczone są w matrycach 10 na pozycjach załadowczych podajnika rewolwerowego. Na pozycjach obciskania kolejne stemple 6 powodują stopniowe obciskanie górnej ścianki miseczki. Na pozycji wyładowczej zderzaki 11 wciskają tuleję 8 i gotowy detal pod wpływem strumienia powietrza opuszcza matrycę 10 kierując się rynną 12 do pojemnika.

Zastrzeżenia patentowe

1. Sposób kształtowania jednoczęściowej miseczki wyprowadzenia anody zwłaszcza lampy kineskopowej polegający na obciskaniu miseczki wyjściowej poprzez nacisk pionowy, **znamienny tym**, że nacisk pionowy realizuje się za pomocą kolejnych stempli (6) o różnym kącie pochylenia powierzchni kształtującej przy czym detal w kolejnych fazach obciskania znajduje się w jednej i tej samej matrycy (10).

2. Sposób kształtowania według zastrz. 1, **znamienny tym**, że stosuje się dociskacze (7) dna miseczki osadzone sprężysto wewnątrz stempli obciskających (6).

3. Urządzenie do kształtowania jednoczęściowej miseczki wyprowadzenia anody zwłaszcza lampy kineskopowej przez obciskanie miseczki wyjściowej realizowane naciskiem pionowym **znamiennie tym**, że posiada zespół stempli (16) z możliwością regulacji położenia pionowego bez konieczności zdejmowania przyrządu z prasy oraz zespół matryc (10) z wciskаныmi tulejami (8).

